

ContourX-100 Optical Profilometer

- 高性能な粗さ測定のために合理化されたお手頃な価格のベンチトップモデル

ContourX-100 Optical Profilometerは、正確で再現性の高い非接触式表面形状測定の新しい基準を、クラス最高の価格帯で実現しました。ContourX-100は、数十年にわたるブルカー独自の白色光干渉計（WLI）の革新的な技術を取り入れた合理化されたパッケージで、妥協のない2D/3Dの高解像度測定機能を提供します。ゲージ対応のベンチトップシステムは、業界で最も先進的なユーザーフレンドリーなインターフェースを備えており、精密機械加工された表面、厚膜、トライボロジーアプリケーションのための事前にプログラムされたフィルターや分析の豊富なライブラリに直感的にアクセスすることができます。次世代の機能強化には、新しい5MPカメラ、更新されたステージ、新しい測定モードが含まれており、さらに幅広い柔軟性を実現しています。ContourX-100以上に合理化されたベンチトップシステムで、これ以上に価値のあるものはありません。

高速で再現性の高い3D計測

- 観察倍率に依存しない業界最高のZ解像度を実現
- 広域な標準視野
- 最高の安定性と再現性を実現するためのコンパクトで振動に強い設計

優れた測定と分析機能を装備

- 使いやすいインターフェースで迅速かつ正確な結果が得られます
- 粗さ、表面テクスチャ、臨界寸法のためのフィルタと解析オプションの豊富なライブラリを提供
- ISO 25178、ASME B46.1、ISO 4287などの業界標準に合わせたカスタマイズされた分析レポート

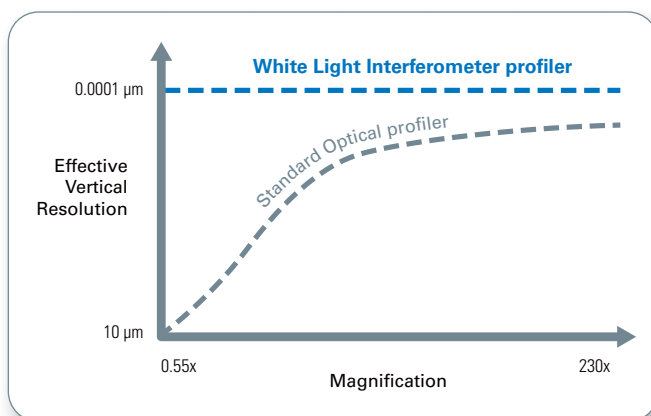
Optical Profilometer

他に類を見ないメトロロジー能力

ContourX-100プロファイラーは、これまでに培ってきた技術の集大成です。40年にわたる独自の光学技術革新と非接触表面計測で業界をリードしています。特性評価、画像化を行うことができます。システムは、3D 白色光干渉法と2Dイメージング技術を用いた多重解析を1回の取得で実現します。反射率0.05%から100%までの試料をContourX-100はすべての表面形状粗さに対応します。

他に類を見ない価値を生み出す分析機能

カスタマイズされた様々な分析とブルカーのシンプルでパワフルなVisionXpress™とVision64@ユーザーインターフェイスによりContourX-100ベンチトップモデルはラボと工場の両方の生産性を向上させる最適化された仕様に仕上がっています。業界トップクラスの高スループット測定を実現する光学系とソフトウェアを組み合わせることで合理化された装置性能は、表面形状の計測技術業界を完全に凌駕します。



WLI offers constant and ultimate vertical resolution for all objectives.



ContourX-100 manual stage.

ContourX-100 Specifications

スキャン範囲	≤10 mm
垂直分解能 ¹	<0.01 nm
横分解能	0.38 μm min (スパロー基準); 0.13 μm (AcuityXR®)
段差測定精度 ²	<0.75% 段差
段差再現性	<0.1% 1/σ
最大スキャン速度	37 μm/sec (標準カメラ使用時)
反射率範囲	0.05% to 100%
サンプル傾斜限界	≤40° (光沢のある表面); ≤87° (粗い表面)
サンプル高さ	≤100 mm (4 in.)
XY サンプルステージ	150 mm (6 in.) 手動操作
Z フォーカシング	100 mm (4 in.) 自動操作
傾斜調整機能	±6° (4 in.)
光学計測モジュール	特許取得済みのデュアルカラーLED照明 単一対物レンズアダプタ 自動 (オプション) または手動タレットハウジング 電動 (オプション) または手動ディスクリートモジュール
対物レンズ パフォーカル	標準型: 2.5X, 5X, 10X, 20X, 50X, 115X 長作動型: 1X, 1.5X, 2X, 5X, 10X; 環境制御型TTM: 2X, 5X, 10X, 20X; 明視野型: 2.5X, w5X, 10X, 50X
光学ズームレンズ	0.55, 0.75X, 1X 1.5X, 2X
カメラ	白黒 (標準) 5MP カラー (オプション) 5MP (1200x1000 Pixel)
ソフトウェアシステム	Vision64 およびVisionXpress 解析ソフトウェア (Windows 10 OS)
ソフトウェアパッケージ	USI; Advanced PSI; Production Mode; VisionMAP; AcuityXR®; 光学解析; SureVision; Film; MATLAB; SDK, TCP/IP
自動機能	光量, 焦点合せ, 解析データ保存、データベース記録
装置校正	NIST/PTBに準拠
設置面積	451 mm (W) x 533 mm (D) x 754 mm (H)
装置重量	60 kg
保証	12 ヶ月 (納入後)

¹ SiC リファレンスマイラー上 30回連続測定時の再現性測定 Sq/σ 値。PSI Mode

² 基準段差 8μm以上の絶対精度値

● ブルカー・ジャパン株式会社 ナノ表面計測事業部 Bruker Nano Surfaces Division

東京都中央区新川1-4-1
Phone : 03-3523-6361
Info-Nano.BNS.JP@bruker.com

www.bruker.com/ContourX-100